

2019年第2回ナノインプリント技術研究会

日程:2019年5月9日(木) 場所:大田産業プラザPiO4Fコンベンションホール
 講演会13:00-15:40 ポスター展示15:50-16:50 名刺交換会(懇親会)17:00-19:00

プログラム

13:00-13:05 運営委員長挨拶
 平井 義彦 (大阪府大学)

13:05-13:30 ナノインプリント技術の動向
 平井 義彦 (大阪府立大学)

基調講演 1

13:30-14:10 半導体ナノインプリントリソグラフィの開発最新状況
 東木 達彦 (東芝メモリ)

14:10-14:20 休憩

基調講演 2

14:20-15:00 ナノインプリントを用いた無痛針の作製
 青柳 誠司 (関西大学)

基調講演 3

15:00-15:40 微細積層印刷の技術
 日下 靖之、野村 健一 (産業技術総合研究所)

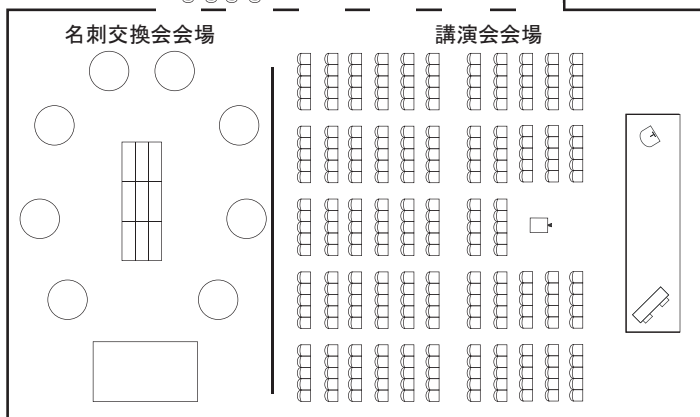
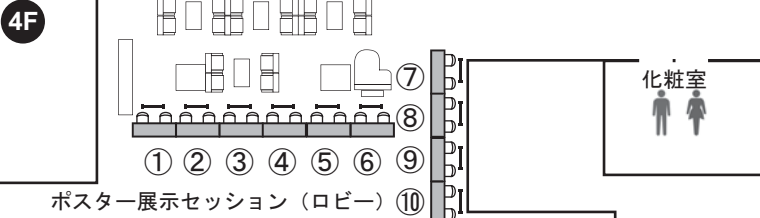
15:40-15:50 休憩

15:50-16:50 ポスター展示セッション

- ① ウシオ電機 (株)
- ② (株) エイチ・ティー・エル
- ③ (株) エリオニクス
- ④ (株) 協同インターナショナル
- ⑤ (株) 三井
- ⑥ 綜研化学 (株)
- ⑦ 長瀬産業 (株)
- ⑧ (株) ホロン
- ⑨ 明昌機工 (株)
- ⑩ リソテックジャパン (株)

17:00-19:00 名刺交換会・懇親会

4F コンベンションホール フloorプラン



参加申込方法

参加申込方法:

会員・非会員参加可、参加費無料、会員はテキスト無料、会員以外はテキスト3,000円、懇親会3,000円。領収書は当日お渡し致します。
 今回の研究会は、会員以外の方も無料で参加が可能です。ナノインプリント技術研究会のWebサイトから4月18日(木)までにお申込みください。

アクセス

